

A02-4 配位結合を活用した近接積層の設計と高密度共役

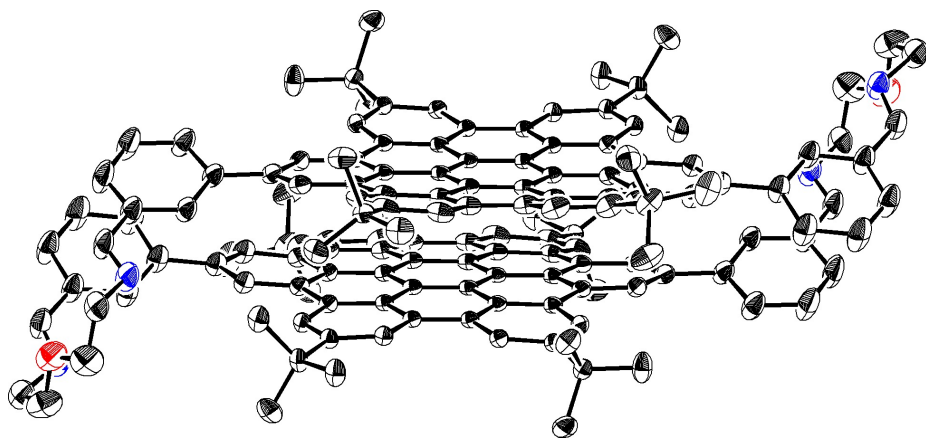
研究代表者：秋根 茂久 (金沢大)

A02班のミッション：分子間相互作用の最大化により高密度共役を固定化する

A02-4の狙い

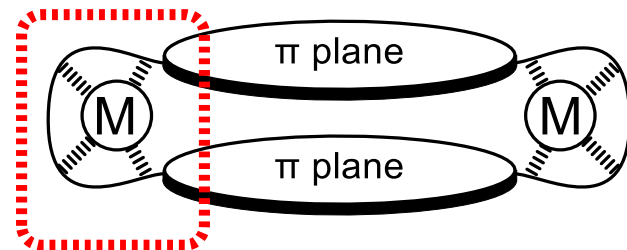
- 配位結合形成を駆動力とする π 平面の近接積層・高密度共役の実現
- 適切な金属の選択による積層距離・パターンの調節

配位結合形成部位を持つ π 平面二量体



グラファイト型のスタッキングパターン

配位結合による π 平面の近接化のコンセプト



配位結合により面間距離を積極的に短くする